

Title (en)

Method and tumbling apparatus with two oscillating movements

Title (de)

Verfahren und bewegte Vorrichtung mit zwei Schwingungsbewegungen

Title (fr)

Procédé et dispositif de polissage par abrasion des surfaces "au tonneau" avec deux mouvements oscillatoires

Publication

EP 1378322 A1 20040107 (FR)

Application

EP 02405561 A 20020704

Priority

EP 02405561 A 20020704

Abstract (en)

The method for polishing the surface of a part (2) with a polishing product (10) contained in a tank (1) consists of fixing the part to a support piece which holds it in contact with the polishing product. The support part is then given an oscillatory movement (A) so as to cause in the polishing product an induced circular movement which engenders its displacement in contact with the part. An Independent claim is included for a polishing device.

Abstract (fr)

L'invention se rapporte à un procédé de polissage d'au moins une pièce (2) avec un produit de polissage (10) contenu dans une cuve (1), au moins une surface de la pièce (2) étant exposée au contact dudit produit de polissage (10), ce procédé étant caractérisé en ce que : on fixe chaque pièce (2) destinée à être polie à un support de pièce (1, 100) qui maintient cette pièce (2) au contact du produit de polissage (10), et on impose à au moins l'un des deux éléments que sont ledit support de pièce (1, 100) et ledit produit de polissage (10), au moins un premier mouvement oscillatoire (A) dont on choisit préalablement l'orientation, l'amplitude et la fréquence de manière à provoquer dans ledit produit de polissage (10) au moins un mouvement induit (B, C) qui engendre son déplacement au contact de la pièce (2). <IMAGE>

IPC 1-7

B24B 31/027; B24B 31/06

IPC 8 full level

B24B 31/027 (2006.01); **B24B 31/06** (2006.01)

CPC (source: EP)

B24B 31/027 (2013.01); **B24B 31/064** (2013.01)

Citation (search report)

- [XY] WO 0029171 A1 20000525 - MTU MUEENCHEN GMBH [DE], et al
- [XY] EP 0922530 A2 19990616 - KAWASAKI SHUJI [JP]
- [A] US 4012869 A 19770322 - BALZ GUNTHER W
- [A] US 4067147 A 19780110 - LELIAERT RAYMOND M

Cited by

DE102011116562A1; CN103612192A; CN115213805A; US2014220869A1; CN108044490A; ITBO20100631A1; US2014235146A1; CN115870872A; WO2012052873A3; WO2011045285A1; EP4372484A1; EP2629934B1

Designated contracting state (EPC)

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR IE IT LI LU MC NL PT SE SK TR

DOCDB simple family (publication)

EP 1378322 A1 20040107; EP 1378322 B1 20060906; AT E338611 T1 20060915; DE 60214528 D1 20061019; DE 60214528 T2 20070606; ES 2272657 T3 20070501; PT 1378322 E 20070131

DOCDB simple family (application)

EP 02405561 A 20020704; AT 02405561 T 20020704; DE 60214528 T 20020704; ES 02405561 T 20020704; PT 02405561 T 20020704